DV-Xα 分子軌道法による XPS スペクトルの理論と実験的評価 およびマテリアルズ・インフォマティクスの応用

岡光 序治*·田中 武**

(平成30年10月31日受付)

The Theoretical and Experimental Estimation about XPS Spectra Using DV-X α Molecular-Orbital Method and Its Application to Materials Informatics

Nobuharu OKAMITSU* and Takeshi TANAKA**

(Received Oct. 31, 2018)

Abstract

The technology surrounding semiconductors is making a steady progress. They are becoming more integrated by micro fabrication technology and the innovative application of such technology is being developed rapidly by finding or applying new materials. In this study, we pay attention to material surface because it affects the quality of products. We analyze both theoretical and experimental sides and estimate the results synthetically. We will apply this method to Materials Informatics and contribute to developing new materials.

Key Words: surface analysis, XPS, DV-Xa, SESSA, Materials Informatics

1 はじめに

半導体技術は日進月歩で進化し、微細加工技術の向上に よるさらなる高集積化や高性能化はもとより、新しい材料 素材の発見や応用による革新的な用途開発などが盛んに行 われている。

アメリカでは、アメリカのイノベーターが先進的な材料 をより迅速かつ経済的に発見、開発、製造、展開するため に必要なインフラストラクチャとトレーニングを提供する ことにより、開発期間を短縮することを目的とする「グ ローバル競争力のためのゲノムイニシアチブ」を設立した。

国家科学技術評議会の特別グループによって準備された このイニシアチブは、データ共有と分析のための新しい国 家インフラストラクチャを提案し、科学者とエンジニアが 新しいマテリアルを設計するために大幅に強化された知識 ベースを提供する。この努力は、強化された計算能力、 データ管理、既存のフェデラル投資をより有効に利用し補

* 広島工業大学大学院工学系研究科知的機能科学専攻

完するためのマテリアルデプロイメントのための統合エン ジニアリングアプローチを奨励している¹⁾。

ヨーロッパでは,新材料ディスカバリーラボラトリーで ある NOMAD は,2015年秋に設立された欧州の優秀研究 センター (CoE) である。4つの高性能コンピューティン



図1 「グローバル競争力のためのゲノムイニシアチブ」の概要

^{**} 広島工業大学工学部電子情報工学科

グ(HPC) センターとともに,計算材料科学における最高 の科学的地位を持つ8つの補完的な研究グループが,この CoEの相乗的なコアを形成しています²⁾。



図2 NOMADのゴール

中国の上海大学において、Materials Genome Institute (MGI),世界クラスの MGI 研究プラットフォームが2015 年4月に構築された。MGI には、中国科学アカデミーと中 国工科大学の6人の学者を含む、設備の整ったラボ施設と 優れた教員がいる。20以上の有名な海外学術機関や大学と の共同研究を行っている³⁾。

韓国では、2015年から"Creative Materials Discovery Project"を10年計画で立上げ。2016年,韓国科学技術研究 所(KIST)において、"Materials Informatics Database for Advanced Search (MIDAS)"が設置された⁴⁾。

台湾では, ITRI が中心なり, Materials informatics に関 する拠点が形成され, 台湾 成功大学に人材育成のための プログラムを用意されている⁵⁾。

日本では、様々なプロジェクト(報告も含む)が進めら れている⁶⁻⁹⁾。文部科学省の高効率に革新的な物質・材料を 探索・設計するためのマテリアルズインフォマティクスの 推進¹⁰⁾ や、内閣府による戦略的イノベーション創造プログ ラム (SIP) 統合型材料開発システムによるマテリアル革 命¹¹⁾ について示す。

文部科学省の高効率に革新的な物質・材料を探索・設計 するためのマテリアルズインフォマティクスの推進におけ る,マテリアルズインフォマティクスの概念イメージを図 3に示す。

内閣府による戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) 統合型材料開発システムによるマテリアル革命の全 体構想を,図4に示す。

本研究においては、半導体の中で広く使われているシリ コン(ケイ素・Si)を対象に、製品の品質などに影響を与 える「表面」に着目し、理論的及び実験的に表面分析し、 それぞれの結果を比較評価した。



図3 マテリアルズインフォマティクスの概念イメージ(既存材 料を超える新たな材料を膨大なデータから発掘)



図4 統合型材料開発システムによるマテリアル革命の全体構想

具体的には、第1原理計算の一つである DV-Xa 法によっ て、Si の表面の電子状態を近似的に求め(当該物質の特性 の推定)、同法により当該物資、すなわち、Si の表面につ いて XPS スペクトルの理論計算を行った。次いで、SESSA のソフトを用いてその表面の XPS スペクトルをシュミレー トし、理論と実測の結果を比較評価した。

このように総合的に物性評価する手法をマテリアルズ・ インフォマティクス¹¹⁾ に適用すれば,新素材開発などへの 手段の一つとなるものと考えた。

2 本研究の理論と実験

2-1 DV-Xα 分子軌道法

すべての化学物質は,天然に存在する約90種類の元素か らできていて,原子が複数個結合したものである。分子が できるときには,原子軌道から分子軌道ができ(分子軌道 法),使った原子軌道の数だけ分子軌道ができる。

2-1-1 Xα法

DV-Xα 法はスレーター(Slater)によって提案されたものであるが、一般的な第一原理分子軌道計算法であるハートリー・フォクス(Hartree-Fock)法が元になっている。

この方法では、多電子系において、一電子近似という方 法を用いる。ある一つの電子には原子核による引力と他の 電子による斤力が作用するが、他の電子から作用する力は、 それらの電子の平均的な電荷密度による静電斤力で近似で きると考える。そして殻電子は他の電子と原子核の作る平 均電場の中を独立に運動し、そのポテンシャルによって決 まる軌道を運動すると考える。

ハートリー・フォクス法では系の全エネルギーは運動エ ネルギー,原子核の引力,平均場に含まれる自己相互作用 の補正のほか二つの電子の座標を交換した場合を考慮した 交換ポテンシャルからなっている。

DV-Xα 法では、この交換ポテンシャル項としてスレー ターにより提案された次の式を用いる。

$$V\chi i(\mathbf{r}) = -3\alpha [3/4\pi\rho(\mathbf{r})]^{1/3}$$
(2.1)

 α の値はH原子で0.978, He τ 0.773, Li τ 0.781となり, それ以降は原子番号とともに減少していくが,これまでの 多くの報告から α =0.7とするとどのような原子についても 実験値をよく再現できる計算結果が得られることが判って いる¹²⁾。

この式は、交換ポテンシャルが電荷密度の1/3乗に比例す ること、またα係数を用いることが Xα 法の特徴であり、 名前の由来である。

2-1-2 DV-Xα分子軌道法

分子軌道法ではまず原子核の位置が固定していると仮定 する(断熱近似)。次に,波動関数は,分子全体に広がりを 持つような軌道を電子が運動すると仮定するので,複数の 散乱中心を持つ波動を表すものになる。

分子内の電子の運動については、分子に対するシュレ ディンガー方程式によって表される¹²⁾。

 $H\phi = E\phi \tag{2.2}$

式 (2.2) で、 ϕ は未知の関数。分子の中の電子の軌道を うまく表すように近似関数を用いることになる。通常、よ く 使 われるのは LCAO (Linear combination of atomic orbitals) と呼ばれる、分子軌道を構成原子の原子軌道の線 形結合で近似する方法である³⁾。

2-1-3 マリケンの電子密度解析 (Mulliken population analysis)

分子軌道計算の結果,分子軌道とそのエネルギーが得ら れる。分子中の電子は,様々な分子軌道で運動しているこ とになるが,その電子の分布により,分子を構成する各原 子のイオン性や各原子間の共有結合性が変化する。イオン 性や結合性の情報を得るためには,得られた分子軌道から 電子の分布(電子密度)を求める必要がある。その方法の 一つがマリケンの電子解析である¹²⁾。

2-2 原子軌道と量子数¹³⁾

2-2-1 原子軌道 (atomic orbital)

電子の分布の形状は電子の波動性のため、不連続となる (決まった波長の波以外は波の干渉のため存在できない), これを量子化(quantization)という。

この量子化された電子状態と対応するエネルギーはシュ レイディンガー(Schrödinger)方程式を解くことで求める ことができる。量子化された電子状態とエネルギーを決め る指数を量子数(quantum number)という。

原子に関係する量子数は, 主量子数 (principal quantum number: n), 方位量子数 (azimuthal quantum number: l), 磁気量子数 (magnetic quantum number: m) がある。

電子状態の決まり方の順は,主量子数→方位量子数→磁 気量子数である。

電子状態は n, l, m のいずれかが異なると, 異なる状態 である。n, l, m で定まる電子のエネルギーと電子状態を 表す数学的関数を原子軌道 (atomic orbital) といい, 原子 軌道に対応するエネルギー値をその軌道のエネルギー準位 (energy level) という。

1つの原子軌道にスピン量子数 (spin quantum number) を異にして2個の電子が入ることができる。

通常,電子はもっともエネルギーが低くなるように入る。 電子の入り方を電子配置(electronic configuration)といい,もっとも低いエネルギーの電子配置の状態を電子の基 底状態という。

2-2-2 主量子数 (principal quantum number: n)

nは原子軌道の基本となる量子数であり,nの値は,原 子軌道によって決まる電子分布の原子核からの大まかな距 離を表す指標である。

nは、n=1,2,3,…の自然数をとり、それぞれK殻、 L殻、M殻、…という名称が付けられている(右図)。これ を電子殻(electronic shell)という。

電子殻は, 主量子数 (n) とそれに付随する方位量子数 (l), 磁気量子数 (m) を合わせたものをいう。

各殻によって収容できる電子数が異なり主量子数nに対し、2n²個が最大収容電子数である。

K 殻には 2 個, L 殻には 8 個, M 殻には 18 個の電子を収容できる。



図5 K殻, L殻, M殻

2-2-3 方位量子数 (azimuthal quantum number: 1)

方位量子数(1)は、電子の分布の大まかな形状を表す量 子数である。

1は主量子数nに依存し、nがきまると、0、1、2、・・ n-1までの値をとる。n=1なら、1は0のみ、n=2なら、 1は0と1、さらにn=3なら、1は0と1と2という意味 である。

1=0, 1, 2, 3, について s, p, d, f, …の記号がつけら れている。



s型の軌道は球形, p型の軌道は亜鈴状である(右図)。d, f・・になるに従い, 原子軌道の形状はより複雑になる。



図6 s軌道(球形), p軌道(亜鈴状)

2-2-4 磁気量子数 (magnetic quantum number: m)

nと1で定められる原子軌道は,1の値により電子の分布 形状が異なるが,それらの原子軌道に入る電子のエネル ギー値は同じである。

一般に、異なる電子状態が複数あり、それらのエネル ギーの値は等しい場合は、縮重(縮退:degeneration)し ているという。1≠0のとき原子軌道は縮重している。しか し、磁場を与えると電子の分布方向の違い(あるいは電子 の運動の方向が異なること)により、電子の運動が発生す る磁場との反応が異なる(これを異方性(anisotropy)とい う)。そのため、磁場のなかでは、原子軌道のエネルギーは 1の値によって異なる(分離する)。

このように縮重した状態が分離することを一般に解縮重 (解縮退)という。

s 軌道に入った電子は球状に分布するため,磁場の方向 によって,エネルギーは変わらないが,p原子軌道では電 子の運動方向が磁場の方向に対し等価でないため,磁場を 与えるとエネルギー差が生ずるようになる。



磁場によって分離する状態の数は、1の値に対して、-l、 -l+1、-l+2、…0、1、2、…1の合計 2l+1 個がある。 これらを m の記号で表し磁気量子数という。

m は方位量子数1に依存し、1=0 なら、m=0 のみ(1 状態)、1=1 なら、m は-1 と0と1の3 状態、さらに1= 2 なら、m=-2、-1、0、1、2 の5 状態があるという意味 である。(副殻の数、3 つのp 軌道、5 つのd 軌道など)要 するに、1=0 の場合は軌道の形が球状であるため磁場を与 えても分離しないが、1=0 以外は磁場による異方性により m で与えられる状態数に分離する。

2-2-5 スピン量子数 (spin quantum number: s)

電子は2つの方向のどちらかに自転している。一方の自 転の大きさは½h, 他方は –½h の角運動量を持ち, 前者 を α スピン電子 (α-spin electron), 後者を β スピン電子 (β-spin electron) という。

hの前の係数½と –½をスピン量子数という。つまり、 α スピン電子は½を、 β スピン電子は –½のスピン量子数 を持つ。

α スピン電子とβスピン電子では反対の磁場を発生する ので,外から磁場を与えられるとそれらが相互作用してス ピンの違いによりエネルギーが異なる。

2-3 XPS & SESSA

固体の表面の特性や機能は、表面の化学構造によって決 まる。固体の表面数原子層という非常に浅く薄い領域の化 学構造を明らかにする手法が表面分析法である。

固体表面を調べるには、表面を刺激して出てくる信号を 調べる。表面の刺激には、光・X線・電子が用いられてい る。表面刺激によって出てくるさまざまな信号の中から、 表面だけから出てくる電子・イオンなどの粒子を観察し、 その特性を解析することにより表面の化学構造を明らかに することができる。表面分析の代表的な種類には、XPS、 TOF-SIMS、AFS などがある。XPS は、X線を照射して光 電効果によって発生する光電子のエネルギーを分析する手 法であり、表面の組成と化学結合状態の分析ができること が特徴である。

2-4 X線光電子分光法 (XPS) の原理と応用¹⁴⁾ 2-4-1 はじめに

X線光電子分光法は、表面数 nm に存在する元素(Li~U)に対し、定性・定量分析のみならず、材料の特性を決める化学結合状態分析ができる手法として広く普及している。 X線光電子分光法はXPS(X-ray Photoelectron Spectroscopy)の名称だけでなく、ESCA(Electron Spectroscopy for Chemical Analysis)の呼び名で1970年代以降広く知られている。 XPS は励起源として軟 X 線を用いているため,励起光に よる試料損傷が少なく,絶縁物の帯電も容易に除去できる ことから,金属材料だけでなく,高分子材料など多くの材 料に対して測定が可能です。

2-4-2 原理

XPS は MgKα, AlKα などの軟 X 線を物質(A) に照射 し,物質(A)のイオン化に伴い放出される光電子 e-を補 足しエネルギー分析を行う手法です。

$$\mathbf{A} + \mathbf{h}\mathbf{v} = \mathbf{A} + \mathbf{*} + \mathbf{e} - \tag{1}$$

励起源としてX線を用いる方法がXPSで,一方真空紫外光 を用いる方法が真空紫外光電子分光法(UPS: Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy)と呼ばれています。

固体表面における光電子放出の模式図を図8に示す。



図8 光電子放出模式図

また図9にPTFE(polytetrafluoroethylene)フィルムを 分析して得られた光電子スペクトル(ワイドスペクトル) を示す。光電子は各電子軌道から放出されるため,得られ る光電子ピークは図に示すように元素と電子軌道でそれぞ れ表記する。図9ではCls,Flsと表記されている。





図8の光電子放出過程は式(2)で示すことができます。

$$\mathbf{E}\mathbf{k} = \mathbf{h}\mathbf{v} - \boldsymbol{\phi} \tag{2}$$

ここで ϕ は固体の仕事関数 (work function) です。電子が

フェルミ準位までの準位を全て満たし, 照射X線エネル ギーが十分に大きいときに放出光電子のエネルギー分布が 測定できるならば,式(3)が成り立つ。

$$\mathbf{E}\mathbf{k} = \mathbf{h}\mathbf{v} - \boldsymbol{\phi} - \mathbf{E}\mathbf{b} \tag{3}$$

式(3)において、hvは一定、Ekは測定運動エネルギーで あるから, φがわかれば Eb (束縛エネルギー, または結合 エネルギーと呼ばれているが、ここでは結合エネルギーで 表記します)が求められる。固体試料の場合,結合エネル ギーはフェルミ準位を基準として表されます。この基準と なるのは、試料とスペクトロメータのフェルミ準位が平衡 しているという仮定に基づいている。この仮定は金属など 導電性物質に対しては成り立つが、絶縁性物質では光電子 の放出により、物質表面に過剰の正電荷が溜まる。この現 象は帯電効果(charging effect)と呼ばれ、物質表面に正 電荷が溜まることにより、光電子が真空に放出されるとき の運動エネルギーが減少する。この帯電効果により見かけ 上結合エネルギーが増加して観測される。従って、正しい 結合エネルギーを得るためには、この見かけの結合エネル ギーの増加分を補正しなくてはならない。帯電効果の防止 法としては低速電子線等の照射などがある。

2-5 DV-Xα分子軌道法による XPS スペクトルの理論計算

DV-Xα 法のための総合支援環境が開発されている。とく に初心者が DV-Xα 法のプログラムを総合的に使えるように するためにその環境が整えられていると思われる。

この総合支援環境は以下のプログラムから構成されている¹²⁾。

- (1) DV-Xa 法プログラム一式
- (2) 秀丸エディタ(シェアウェア)
- (3) DY-Xa 法計算支援環境(秀丸エディタマクロ集)
- (4)結晶構造,電子・核密度等の3次元データ,及び結 晶外形の可視化プログラム VESTA
- (5) 教育用分子軌道計算システム eduDV
- (6) 構造ファイル建艦システム Open Babel

2-5-1 Si diamond structure の 3 次元可視化

Siの結晶はダイヤモンド構造をもつ。VESTAを用いて作 図する Si 結晶の基本データを表す(図10参照)。



Si DIAMOND CRYSTAL STRUCTURE Space group : Fd-3m Crystal system : Cubic Side length : 5.43 Angstrom Si – Si bond length : 2.35 Angstrom Lattice point : (0, 0, 0) and (1/4, 1/4, 1/4)

図10 Siダイヤモンド結晶構造の基本データ



図11 VESTAを用いた設定画面の流れ(A)



図12 VESTA を用いた設定画面の流れ(B)



図13 VESTA を用いた設定画面の流れ(C)

結晶構造,電子・核密度等の3次元データ,及び結晶外形の可視化プログラム VESTA を用いた Si diamond structureの3次元可視化の設定の流れを示す。(図11から図14)

次に, Siのエネルギー準位について検討する。

Si-Si はそれぞれ(1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, 3s, 3p)の28個の 電子配置から結合軌道を形成している。右端の数字は分子 軌道における電子の占有数を表す。電子はエネルギー準位



図14 VESTAを用いた設定画面の流れ(D)

_					
		(RY)	(HR)	(EV) \downarrow	
1	1SigU	-130. 02695	-65. 01348	-1768. 82555	2. 00000↓
2	1SigG	-130. 02695	-65. 01348	-1768. 82555	2.00000↓
3	2SigG	-9. 63052	-4. 81526	-131.00905	2.00000↓
4	2SigU	-9. 63035	-4. 81518	-131.00682	2.00000↓
5	3SigG	-6. 50562	-3. 25281	-88. 49934	2.00000↓
6	3SigU	-6. 50440	-3. 25220	-88. 48277	2.00000↓
7	1PaiU	-6. 50390	-3. 25195	-88. 47600	4. 00000↓
9	1PaiG	-6. 50380	-3. 25190	-88. 47462	4. 00000↓
11	4SigG	-0. 60932	-0. 30466	-8. 28897	2.00000↓
12	4SigU	-0. 36254	-0. 18127	-4. 93176	2. 00000↓
13	5SigG	-0. 07273	-0. 03636	-0. 98933	2. 00000↓
14	2PaiU	-0. 05929	-0. 02964	-0. 80653	2.00000↓
16	2PaiG	0. 12019	0.06009	1.63496	0.00000↓
18	5SigU	0. 35223	0. 17612	4. 79158	0.0000↓
19	1DelG	0. 50696	0. 25348	6.89648	0.0000 ↓
21	3PaiU	0. 53071	0.26536	7.21955	0.0000↓
23	6SigG	0. 62973	0. 31487	8. 56655	0.0000↓
24	1De I U	0. 72995	0. 36497	9.92983	0.0000↓
26	3PaiG	0. 98550	0. 49275	13. 40625	0.0000↓
28	6SigU	1. 19630	0. 59815	16.27389	0.0000↓

図15 Si-Siのエネルギー固有値

の低い軌道から順に2個ずつ入る。(パウリの排他律)(Si-Siは合計28個)

次にエネルギー準位図と電子の占有割合について検討する。図15は各軌道の占有割合となっている。

XPSとは試料表面にX線を照射し、試料表面から放出さ



図16 Si-Siのエネルギー準位図

	3s	3p	3d	
-1768.8256,	0.0000,	-0.0000,	0.0000,	2.0000,
-131.0091,	0.0000,	0.0000,	0.0000,	2.0000,
-88.4993,	0.0000,	0.0000,	0.0000,	2.0000,
-8.2890.	0.8929.	0.0966.	0.0104.	2.0000.
-0.9893.	0.0993.	0.8998.	0.0008.	2.0000.
8.5666.	0.0078.	0.0035.	0.9887.	0.0000.
-1768.8256,	0.0000,	0.0000,	0.0000,	2.0000,
-131.0068,	-0.0000,	-0.0000,	-0.0001,	2.0000,
-88.4828,	-0.0000,	-0.0000,	-0.0000,	2.0000,
-4.9318.	0.8556.	0.1167.	0.0277.	2.0000.
4.7916,	0.0253,	0.5608,	0.4139,	0.0000,
16.2739,	0.1191,	0.3225,	0.5585,	0.0000,
-88.4760,	0.0000,	0.0000,	0.0000,	2.0000,
-0.8065.	0.0000.	0.9364.	0.0636.	1.0000.
7.2196.	0.0000.	0.0636.	0.9364.	0.0000.
-88.4746,	0.0000,	-0.0000,	-0.0000,	2.0000,
1.6350.	0.0000.	0.8968.	0.1032.	0.0000.
13.4063.	0.0000.	0.1032.	0.8968.	0.0000.
9,9298.	0.0000.	0.0000.	1.0000.	0.0000.
6.8965.	0.0000.	0.0000.	1.0000.	0.0000.

図17 Siの電子のエネルギー準位における占有割合



図18 Si-Siの各軌道における DOSの出力画面 (a) 3s (b) 3p (c) 3d (d) total



図19 エネルギー準位図と状態密度図の比較

れる光電子の運動エネルギーを計測することで, 試料表面 を構成する元素の組成及び, 化学結合状態を分析する手法 である。

原子の価電荷や原子間の距離など,分析対象となる原子 周囲の電子状態によって起こる結合エネルギーの変化(化 学シフト)が大きく化学結合状態を比較的容易に識別可能 であることが特徴として挙げられる。

図20は Al-K α 線の照射による Si-Si から放出された光電 子のエネルギー Ek を測定し、電子の結合エネルギー EB (Binding Energy) を求め、図示したものである。

5 σg, 2πuより上の軌道レベルは空軌道であり光電子ス







図21 Si-Siの (a) DOS と (b) XPS スペクトルの比較

ペクトルは現れない。このことはエネルギー準位値 [f08e] を見てもよくわかる。

上図はエネルギー準位値 [f08e] も確認しながら比較する ように前述のとおり空軌道は XPS では消え,5 σ g,2 π u の 二つの結合による合計(電子4個)の XPS 強度が4 σ u,4 σ g のほぼ2倍になっていることが確認できる

2-6 SESSA

SESSA (Simulation of Electron Spectra for Surface Analysis) とは、NIST (National Institue of Standards and Technology) のデータベースで、オージェ電子分光及びX 線光電子分光による定量分析のためのシミュレーターである¹⁵⁾。

このデータベースの目的は、表面分析のためのオージェ 電子およびX線光電子スペクトル(AES/XPS)の定量的解 釈を容易にし、ルーチン分析における定量の精度を向上さ せることである。この目的のために、データベースは、所 与の組成を有する試料の電子スペクトルの定量的解釈を行 うのに必要な物理的データを含む。関連データの検索は、 包括的なデータベースを照会する小規模なエキスパートシ ステムによって実行される。SESSA内では、ピーク強度の 推定はもちろん、放出電子束のエネルギーおよび角度分布 を提供するシミュレーションモジュールも利用可能である。 エキスパートシステムがその作業を達成するために必要と する情報は、実際に測定を実施する際に実験者が行った機 器設定とよく一致し、サンプル組成の初期推定値によって 補完される。

SESSAは2つの主な用途に使用できる。まず、定量的 AESとXPS(微分逆弾性非弾性平均自由行程,全非弾性平 均自由行程,微分弾性散乱断面積,全弾性散乱断面積,輸 送断面積,光電クロス電子衝突イオン化断面,光電子線形 状,オージェ電子線形状,蛍光収率及びオージェ電子後方 散乱係数)を用いて、第2に、層状試料および表面上の島, 線,球および層状球などのナノ構造について、オージェ電 子および光電子スペクトルをシミュレートすることができ る。ユーザーが指定した組成と寸法のシミュレートされた スペクトルは、測定されたスペクトルと比較することがで きる。次に、組成および寸法を調整して、シミュレートさ れたスペクトルと測定されたスペクトルとの間の最大の一 貫性を見出すことができる。

SESSA のシミュレーションの概要は次の通り $^{15)}$ 。



図22 SESSAの起動と初期設定



図23 試料情報







図25 X線源/検出器の位置

Experiment			-		
urce Geometry S	pectrometer				
hoose Region #1	~ Add	Delete		Rese	t
Region Settings					
Energy range: Valid region If existing re	bounds are between gion bounds are mo	5.0eV and 20000.0eV. Ified, user changes to peak settings may be lost	t.		
Lower bound [eV]	600.000				1
Higher bound [eV]	1500.000			_	7

図26 エネルギー範囲



なお, SESSA は, 試料の制約がないので, 高価なもの, 有毒物, その他, 現在, 形成できていない物質構造も取り 扱うことができる。

2-7 秘密分散

秘密分散法を用いた,表面分析データの保存方法につい て検討した。

Comproを用いて表示したX線光電子分光データ(図28) を、ファイル名を確認(図29)、Winzipを用いて圧縮(図 30)、Pro-Keeperを用いて保存(図31)できた。データの 解凍は、逆の手順を行うことにより、データの取り出しが 可能であった。



図28 Comproを用いて表示したX線光電子分光データ



図29 X線光電子分光データ(ファイル名の確認)



図30 X線光電子分光データ(Winzipを用いたファイルの圧縮)



図31 Winzipを用いたファイルの圧縮したX線光電子分光データ を秘密分散させ、保存(秘密分散には、Pro-Keeper(イノ ベーションファーム社製)を利用)

3 マテリアルズ・インフォマティクス

材料探索とは、一般に既知物質の既知特性に対し、別の 物質で同等ないしそれを超える特性を実現することを指 す⁶⁾。研究者が経験と勘に基づいて物質を合成し構造や特 性などを評価するということが行われてきたが、実験科学 や計算科学が高度化する一方で、大量のデータと人工知能 が加わり、これまでにないようなスピードで複雑な現象の 理解や社会的課題の解決が可能になり始めている。

3-1 探索・合成・データ蓄積の循環

蓄積したデータをデータ科学者が AI 技術を駆使してシ ミュレーションする。→その結果を基に材料研究者が試作 品を合成→新しいデータが蓄積され,データの標準化や品 質の向上がもたらされる。

3-2 探索の場に第1原理計算を導入

第1原理計算の導入により,コンピューター上で物質の 諸性質を電子状態に基づいて計算し,基本的なデータベー スを構築することが可能になった。これと経験に基づく データとを合わせ、人工知能のような情報科学の手法を投 入して未知の材料の機能を推定する道が拓けてきた。さら に、多数の化合物群を一度に実験的に自動合成する方法や 研究の各段階で自動的に特性を計測しデータとして蓄積す る方法を組み合わせることによって、合理的かつ高速に求 める特性を持つ未知の物質へ近づいていくことができるよ うになってきている。

これは、マテリアルズ・インフォマティクスと呼ばれ、 実験なしで材料探索ができると紹介されている¹¹⁾。

3-3 DV-Xα法による新材料の探索の試み

DV-Xα法は周期表の全元素を容易にとらえることができ, クラスターモデルを用いて電子構造の計算ができるという 利点がある。

実用の金属材料を設計する上で DV-Xα 分子軌道法が有用 な手段になり得る具体例を示されている¹⁶⁾。合金はある金 属に別の金属を添加して得られるが,その合金効果は添加 元素の近傍の局所的な電子状態の変化が反映されたものと 考えられる。従って,合金の電子状態を,合金元素の原子 の周りに母体の金属原子を配置させたような簡単なクラス ターで,有効に近似できるとされている。一つの具体例と して,ジェットエンジンなどの構造材料として使われる Ni 基超耐熱合金があげられている。この合金は Ni 母相に析出 する Ni₃Al 相により強化されている。そこで,合金クラス ター MNi₃Al₆について,添加元素 M を周期表にしたがって 変えながら電子構造の計算を行う。得られたパラメーター を用いて合金元素の固溶性の予測を行っている。

おわりに

未知物質の表面について、スペクトルデータ解析ソフト を用いてシミュレートし、実験結果を模擬して得られた データをもとに、ピークのエネルギーから元素を推定する。 推定された元素について、DV-Xα 法によって電子状態を計 算しその物質の特性を推定すると同時に XPS スペクトルの 理論計算を行い、両者を比較評価する。

こうした一連の作業の学習と運用を体験する初歩的な教 育システムを構築した。

この技術を応用して材料開発に近づくことができれば幸 いである。

謝 辞

本研究の一部は,広島工業大学大学院工学系研究科電気 電子工学専攻のコースワークの一つである「電子材料・プ ロセス・デバイス開発」の成果の一部を利用しています。 関係各位の先生と,受講生である岩崎正幸君,片山太郎君 に謝意を表します。

また,本研究に支援を頂いた株式会社ミウラ,イノベー ションファーム株式会社に謝意を表します。

文 献

- (1) https://www.mgi.gov/sites/default/files/documents/ materials_genome_initiative-final.pdf
- (2) https://nomad-coe.eu/
- (3) http://en.mgi.shu.edu.cn/index.htm

- (4) www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/juyoukadai/nanozai/ 7 kai/siryo2-2-3.pdf
- (5) https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsik/27/4/27_2017_ 032/_pdf
- (6) https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2013/SP/CRDS-FY 2013-SP-01.pdf
- (7) http://www.cocn.jp/thema66-L.pdf
- $(\ 8\)\ \ http://www.nims.go.jp/nimsforum/files/03_okada.pdf$
- (9) https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2013/WR/CRDS-FY2013-WR-03.pdf
- (10) https://www.mizuho-ir.co.jp/publication/giho/pdf/ 009_11.pdf
- (11) http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/ gijyutu2/015-6/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2014/12/ 15/1354074_002.pdf 文部科学省研究振興局「高効率 に革新的な物質/材料を探索・設計するためのマテイ アルズインフォマティクスの推進」(2014年8月)
- (12) 足立裕彦・小笠原一禎・小和田善之・坂根弦太・水野
 正隆 共著: "はじめての電子状態計算" p. 5~11,
 120, 三共出版 (1998)
- (13) http://w3pharm.u-shizuoka-ken.ac.jp/yakka/Japanese/ inorganic/data_1.pdf
- (14) https://www.jaima.or.jp/jp/analytical/basic/ electronbeam/xps/
- (15) https://www.nist.gov/srd/nist-standard-referencedatabase-100
- (16) 足立裕彦:量子化学(DV-Xα法)による材料設計,精
 密工学会誌59巻6号 p. 873-878 (1993)